

- 4.** Przystosowanie pomieszczeń Laboratorium wytwarzania warstw metalicznych metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE).
- 5.** Zakup aparatury do osadzania warstw metodą MBE oraz mikroskopu SPM.
- 6.** Uruchomienie i testowanie systemu MBE i mikroskopu SPM w warunkach laboratoryjnych.
- 7.** Zakup chłodziarki na hel-3 do układu pomiarowego przejść fazowych w temperaturach sub-kelwinowych (do 50 mK).
- 8.** Dopuszczenie systemu Nano Workstation ZEISS Neon 40 o rentgenowski spektrometr energii EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) oraz zakup systemu katodoluminescencji.